

Capacitive Vacuum Sensor (Canon ANELVA, Daiavac)

キャパシタンスゲージ
M-340DG



●概要

マイクロマシン技術による、小型、高性能キャパシタンスゲージ

絶対圧測定を可能とするキャパシタンスゲージ（静電容量型隔膜真空計）をマイクロマシン（MEMS）技術を用いて作製し、小型化、高性能、低価格を実現した画期的な真空計です。

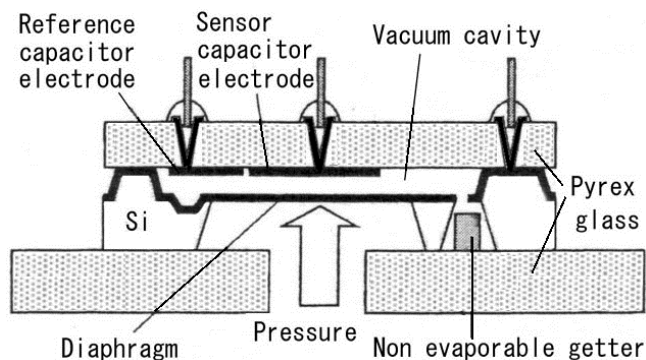
●特長

- コンパクト、低価格
マイクロマシン（MEMS）技術を用いて、小型化、低価格（量産化）を実現
- 測定レンジ 5 タイプをラインナップ
33Pa、133Pa、1.33kPa、13.3kPa、133kPa の 5 タイプ
- 高感度、高再現性
単結晶シリコンダイアフラムの採用により、高感度、高再現性を実現
- メンテナンスコスト低減
センサチップのみの交換が可能*
- 優れた耐震動・ノイズ性
小型・軽量ダイアフラムのため、機械振動ノイズを受けにくい
- 取付け方向を選ばない
垂直、水平、逆さ、どの取付け方向においても正確な測定が可能

●用途

- スパッタリング装置のプロセス圧力測定
- ロートロックチャンバの圧力測定
- ガス分析装置の圧力測定
- 真空乾燥装置の圧力測定
- ランプのガス封入プロセス圧力測定
- 正確な大気圧測定

*メーカーでのチップ交換・調整作業が必要です。



Reference : H. Miyashita, Y. Kitamura, Micromachined Capacitive Diaphragm Gauge, Anelva Technical Report, 11 (2005) pp.37-41 (in Japanese)

DIAVAC LIMITED

Diaphragm Vacuum Gauge
ST-1DB
シリコン隔膜真空計

●相対圧から絶対圧へ!

センサ部にシリコンダイアフラムを採用した小型で絶対圧力測定の隔膜真空計です。表示部にはオートゼロ機能を有し、外部出力3点、絶対にアナログ出力として0~10Vを標準装備しています。小型で使い易さを追求した真空計です。

- 気体の圧力を力として検出しますので気体の種類に関係なく測定ができます。但し、強腐食性気体を除く。
- ダイアフラムにシリコンチップを採用することにより小型で再現性に優れています。
- 検出回路は静電容量方式ですので安定して低圧力まで測定出来ます。
- 表示部はシンプル機能とし、小型で使い易さを実現しました。



DIAVAC LIMITED
大亜真空株式会社
DIAVAC LIMITED

【本拠地】〒200-0005 千葉県千葉市大和田駅前495（大和田工業団地内）
TEL 047 (459) 7628
【支店（東京）】〒532-0033 大阪府大阪市北区高島2丁目14番14号（新大塚ビル4F）
TEL 06 (6396) 1771
E-MAIL diavac@http://www.diavac.co.jp/

●隔膜真空計主仕様

●センサー部仕様 SG-133K		●表示部仕様 ST-1DB	
測定範囲	0.1~133kPa	測定範囲	0.1~133kPa
精度	1% of R	入力電圧	DC0~10V
分解能	0.005% of FS	表示行数	41/2桁
温度係数	ゼロ 0.01% of F/°C	センサー用電源	DC±15V 60mA±5%
スパン	0.1% of R/°C	ゼロ補正範囲	±200mV 前面キー操作
応答速度	0.5sec	出力 アナログ	DC0~10V
定格電源	DC±15V 60mA±5%	設定	3点 プログラム方式
温度範囲	0~50°C	定格電源	AC100V 50/60Hz
内容量	2mL	外径寸法 (mm)	96 (W) × 48 (H) × 172 (D)
標準継手	φ15	取付寸法 (mm)	92 (W) × 45 (H)
外径寸法	φ15×94 140g	質量	600g

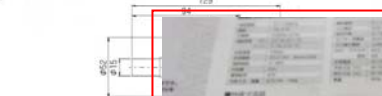
●外寸法図

ST-1DB (表示部)



SG-133K (センサー部)

●標準品



●オプション品



DIAVAC LIMITED